東京ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業 平成29年度 環境モニタリング調査結果

平成30年4月 中間貯蔵·環境安全事業株式会社 東京PCB処理事業所

区分	測定場所	測定項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	定量下限	管理目標値	法定測定	自主測定
水質 (下水)	下水道排水枡	PCB	mg/l	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005	0.0015 以下	年4回	月1回
		pН		8.3	8.3	8.2	8.3	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.1	8.1	_	5を超え9未満	月1回	_
		n-Hex	mg/l	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	5 以下	月1回	-
		BOD	mg/l	1.4	2.0	1.2	0.8	2.1	0.7	ND	2.0	0.7	1.2	0.6	1.4	0.5	600 以下	月1回	_
		SS	mg/l	2	2	ND	1	ND	3	1	3	3	ND	2	1	1	600 以下	月1回	-
		N	mg/l	7.1	7.6	4.5	4.8	7.5	7.0	7.0	11	7.8	6.6	6.8	6.3	0.2	120 以下	月1回	-
		ダイオキシン類	pg-TEQ/l	_	-	ı	0.21	ı	ı	_	_	0.66	_	-	-	-	5 以下	年2回	-
大気 (排気・換気)	排気系統1	PCB	mg/Nm³	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005	0.01 以下	年4回	月1回
	(水熱分解·洗浄系)	ダイオキシン類	pg-TEQ/m³	0.16	-	1	0.29	1	1	0.93	_	_	2.4	-	1	-	100 以下	年2回	年4回
		IPA	ppm	_	-	1	0.3	1	1	_	_	_	<0.1	-	1	-	40 以下	年2回	ı
	排気系統2	PCB	mg/Nm³	0.0006	ND	ND	0.0007	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0005	0.01 以下	年4回	月1回
	(解体室系)	ダイオキシン類	pg-TEQ/m³	6.2	-	ı	4.5	ı	ı	1.8	_	_	4.9	-	-	_	100 以下	年2回	年4回
	換気系統1	PCB	mg/Nm³	0.00010	ND	ND	0.00020	ND	ND	0.00009	ND	ND	0.00007	ND	ND	0.00005	0.001 以下	年4回	月1回
	(洗浄·加熱炉系)	ダイオキシン類	pg-TEQ/m³	0.026	-	-	0.044	-	-	0.16	-	_	0.058	-	-	_	5 以下	年2回	年4回
	換気系統2	PCB	mg/Nm³	0.00020	ND	ND	0.00020	ND	ND	0.00011	ND	ND	0.00011	ND	ND	0.00005	0.001 以下	年4回	月1回
	(解体室系)	ダイオキシン類	pg-TEQ/m³	0.23	-	-	0.089	-	_	0.12	-	_	0.29	-	-	_	5 以下	年2回	年4回
大気 (敷地境界)	南東端	PCB	mg/N m ³	ND	_	-	ND	-	-	ND	-	_	ND	_	-	0.00005	0.0005 以下	年1回	年4回
	北西端			ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-		0.0000 JA [*		
	南東端	ダイオキシン類	pg-TEQ/m³	0.083	_	_	0.14	-	_	0.018	-	_	0.030	_	-		年平均026以下	年1回	年4回
	北西端			0.14	-	-	0.57	-	-	0.032	-	-	0.025	-	-		十一河町 次「	구'법	
水質 (雨水)	排水枡NO.3	PCB	mg/l	_	-	-	-	ND	-	_	-	_	ND	-	-	0.0005	0.0015 以下	年1回	年2回
	排水枡NO.6			-	-	-	-	ND	ı	_	_	_	ND	-	-				
	排水枡NO.11			-	-	-	-	ND	-	_	-	_	ND	-	-				
	排水枡NO.3	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	_	-	_	_	0.22	_	_	_	_	0.12	-	-	_	5 以下	年1回	年2回
	排水枡NO.6			_	-	-	_	0.42	-	_	_	_	1.2	_	-				
	排水枡NO.11			_	-	ı	_	0.62	ı	-	-	_	0.64	-	ı				